

G.

ALN CERAMIC HEATER AND MANUFACTURE THEREOF

Patent number:

JP4324276

Publication date:

1992-11-13

Inventor:

UDAGAWA ETSURO; MURA NAOMI; MAEDA EIZO;

KUMAGAI MASATO

Applicant:

KAWASAKI STEEL CO

Classification:

- international:

C04B35/58; H05B3/14; H05B3/20; H05K1/03;

H05K1/09; C04B35/58; H05B3/14; H05B3/20;

H05K1/03; H05K1/09; (IPC1-7): C04B35/58; H05B3/14;

H05B3/20; H05K1/03; H05K1/09

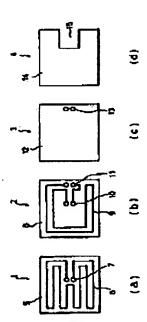
- european:

Application number: JP19910094355 19910424 Priority number(s): JP19910094355 19910424

Report a data error here

Abstract of JP4324276

PURPOSE:To manufacture a ceramic heater of which both surfaces are flat and without protruding an electrode part by contriving uniformity of temperature distribution in a base unit of the ceramic heater, internally furnished with a heating resistor by laminating an AIN substrate, utilizing bear holes as a method of taking out the electrode part to the outside and providing a notch in a brazing part of the electrode part to an external wiring. CONSTITUTION: The first layer substrate 1 has a heating resistor 6 and a terminal 7 in an upper total surface of a ceramic substrate 5. In the second layer substrate 2 has a heating resistor 9 in a peripheral edge part in an upper surface of a ceramic substrate 8. The third layer substrate 3 has vertical through viaholes 13 in a ceramic substrate 12. In the fourth layer substrate 4, the terminal 7 of the first layer substrate 1, having a notch 15, is provided in a position opposed to a beer hole 10 of the second layer substrate 2. A terminal 11 of the second layer substrate 2 is provided in a position opposed to the viahole 13 of the third layer substrate 3. The notch 15 of the fourth layer substrate 4 is provided in a position opposed to the viahole 13 of the third layer substrate 3.



Data supplied from the esp@cenet database - Worldwide

· (19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出顧公園番号

特開平4-324276

(43)公開日 平成4年(1992)11月13日

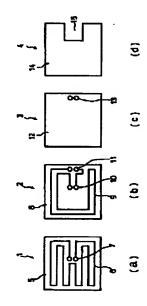
技術表示值用	Fi	庁内整理番号		識別配号	(51) Int.Cl. ¹	
		7913-3K		393	3/20	H05B
		8821-4G	Y	104	35/58	C04B
		8715-3K	В		3/14	H05B
		7011-4E	н		1/03	H05K
		8727-4E	В		1/09	
存金請求 未請求 請求項の数4(全 5 頁)	4					
000001258	(71)出題人		5	₩ ¥3−94355	}	(21)出觀番号
川崎製飲株式会社						
兵庫県神戸市中央区北本町通1丁目1番2		124日	4 F	平成3年(1991)		(22)出顧日
号						
学田川 悦郎	(72)発明者					
千葉市川崎町1番地 川崎製鉄株式会社技						
術研究本部内						
村 直美	(72)発明者					
千葉市川崎町1番地 川崎製鉄株式会社技						
術研究本部内						
弁理士 小杉 佳男 (外1名)	(74)代理人					
最終頁に続く						

(54) 【発明の名称】 A 1 Nセラミツクヒータ及びその製造方法

(57)【耍約】

【目的】A 1 N基板を積屑して発熱抵抗体を内装させた セラミックヒータの基体内の温度分布の均一化を図る。 また電極部を外部へ取出す方法として、ピアホールを利 用し、電極部と外部配線とのろう付け部に切欠を設ける ことによって、電極部が突出しない、両面が平坦なセラ ミックヒータを観査する。

【構成】第1層基板1はセラミック基板5の上面全面に 発熱抵抗体6、端子7を有する。第2層基板2はセラミック基板8の上面の周縁部に発熱抵抗体9を有する。第 3層基板3はセラミック基板12に上下貫通ピアホール 13を有する。第4層基板4は切欠15を有する第1層 基板1の端子7は、第2層基板2のピアホール10対向 する位置に設けられている。第2層基板2の端子11 は、第3層基板3のピアホール13に対向する位置に設 けられている。第4層基板4の切欠15は第3層基板3のピアホール13に対向する位置に設けられている。第



【特許請求の範囲】

【請求項1】 基板の上面に発熱抵抗体を設け、その上 にピアホール電極を有する基板及び設電極部に対応する 切欠を有する最上層基板を積層してなることを特徴とす るAINセラミックヒータ。

【酵求項2】 上面に発熱抵抗体を設けた基板が複数の 積層体であり、鉄基板上の発熱抵抗体を結合する導通ビ アホールを有することを特徴とする請求項1配戦のAl Nセラミックヒータ。

AIN質焼結体であり、発熱抵抗体がW-AINの複合 焼結体からなり10-40・cm以下の室温時の電気抵抗 率及び正の抵抗温度係数を有することを特徴とする研究 項1又は2記載のA1Nセラミックヒータ。

【請求項4】 厚膜印刷法によって発熱抵抗体を形成 し、政発熱抵抗体をグリーンシート積層法によりセラミ ック基体中に埋設することを特徴とする請求項1、2又 は3配載のA1Nセラミックヒータの製造方法。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は、家庭用機器、電子機 器、産業用機器、及び自動車等に利用されるセラミック ヒータ及びその製造方法に関する。

[0002]

【従来の技術】これまでにセラミックスを基体とするヒ ータとしては、W (タングステン) -アルミナ系、ある いはMo(モリブデン)-アルミナ系において実用化が 図られており、多くの製品がでている。このようなアル ミナ系におけるセラミックヒータは基体が電気的、化学 的に安定であるばかりでなく、発熱抵抗体の電気的特 30 性、熱的特性に関して設計上に多くの利点を有する。

【0003】しかし、アルミナは熱胞張が大きく、熱伝 導が思いことから急致な温度変化に弱く、耐熱衝撃温度 が150~250℃と低い。さらに、熱伝導性に劣るこ とから、プレート状の基体の場合には、通電時に発熱部 とプレート周辺部の程度差が大きくなりやすく、被加熱 物に対する熱伝達効率が低いといった問題がある。ま た、家庭用機器、電子機器、産業用機器及び自動車用と 広く用いられいているセラミックヒータ一般に対し、

- (1) 股定の温度への到達時間の短縮
- (2) 熱サイクル及び電圧印加サイクルにおける、電 気的、機械的信頼性の向上
- (3) 熱伝液効率の向上
- (4) 使用環境に対する耐性の向上

などの要求が高まってきている。このような要求に対 し、アルミナを基体とした既存のセラミックヒータでは 十分に応えられなくなっている。

【0004】そこで、従来のアルミナに代る基体とし て、宝化アルミニウム(AIN)又は空化ケイ素などの

に優るだけでなく、特に、AINは熱膨張が小さい上 に、熱伝導率がアルミナの10倍程度もあることなどか ら、新しいセラミックヒータ用の基体として有望視され

【0005】しかし、A1Nはアルミナと比べ単身でも 焼結が難しく、発熱抵抗体を内蔵したものはいまだに実 現していない。これはA1Nの焼成が一般には1800 ℃以上という高温でなされることと、脱陷及び空来不牚 囲気でなされることが原因で、AINと同時に焼成でき 【節求項3】 基板が熱伝導率160W/m・K以上の 10 る材料が限られているためである。これまでに、A1N と同時に体成できる材料としてWやMnをはじめとする 高融点金属を用いた開発が進められてきたが、AlNと の焼結性の一致をはかりながら所還の物性値を得ること が困難であった。

> 【0006】また、宛熱抵抗体のパターンをセラミック 焼結体内に形成する方法も、単純なものに限られてお り、このためプレート状の基体表面での温度分布が不均 一となったりする場合が多い。

[0007]

【発明が解決しようとする課題】本発明は、従来からあ るセラミックシートの積層技術と厚膜印刷技術、さらに はスルーホールメタライズ技術を用いて、発熱抵抗体を 内蔵したセラミックヒータを開発するにあたり、プレー ト状の基体内の温度分布の均一化を図ることを目的とす る。また電極部を外部へ取出す方法として、ピアホール を利用する技術、さらには電極部とニクロム線等の外部 配線との基体中におけるろう付け部に切欠を設けること によって、電極部が突出しない、すなわち両面が平坦な セラミックヒータを製造する技術を提供する。

[0008]

【課題を解決するための手段】本発明は、基板の上面に 発熱抵抗体を設け、その上にピアホール電響を有する基 板及び酸低極低に対応する切欠を有する最上層基板を積 層してなることを特徴とするAINセラミックヒータで ある。この場合、上配上面に発熱抵抗体を設けた基板を 複数の積層体とし、これらの基板上の発熱抵抗体を導通 ピアホールで結合すると好適である。

【0009】また、本発明のA1Nセラミックヒータは その好ましい実施記様として、基板が熱伝導率160W /m・K以上のA1N質焼結体であり、発熱抵抗体はW -AlNの複合焼結体からなり室温時の電気低効率が1 0-4 Ω・ c 皿以下でかつ抵抗温度係数が正であるセラミ ックヒータを提供する。また、上記のようなセラミック ヒータの製造方法としては、厚膜印刷法によって発熱抵 抗体を形成し、グリーンシート積層法によって発熱抵抗 体をセラミック基体中に埋設する。

[0010]

【作用】本発明は、AINを基体としたセラミックヒー タであって、内閣された発熱抵抗体として、W、Wの酸 セラミックスが注目されている。これらは機械的な強度 50 化物、あるいはWの酸化物からの変成物よりなる少なく

とも1種類以上の主成分と、基体となるAINとの複合 焼結体を用いる。本発明はこのような場合のセラミック ヒータ基体の構造及び発熱抵抗体のパターンの配列、並 びに電極の外部への取り出し構造を改善したものであ ٥.

【0011】本発明は次の作用を生じる。

- (1) ヒータパターンを積層し、3次元配線とするこ とによって、熱密度を向上させる。
- (2) 基体内の程度分布が均一化する。
- (2) って、始子を基体外部へ輩出させない。

【0012】(4) 最上層基板は切欠を設けた構造に より、立体的な基体とし、外部電極部の突出部をなく し、両面が平坦となるようにする。

[0013]

【実施例】図1、図2に、本発明の実施例の説明図を示 した。実施例は4層積層体である。第1層基板1はセラ ミック基板5の上面全面に発熱抵抗体6、帽子7を有す る。第2層基板2はセラミック基板8の上面の周縁部に 12に上下貫通ピアホール13を有する。第4層基板4 は切欠15を有する第1層基板1の端子7は、第2層基 板2のピアホール10対向する位置に設けられている。 第2暦基板2の端子11は、第3層基板3のピアホール 13に対向する位置に設けられている。第4層基板4の 切欠15は第3層基板3のピアホール13に対向する位 世に設けられている。

【0014】 次に実施例の製造方法を説明する。平均粒 番1、2μmのA1N粉末 (酸素含有量0、65重量 %、カーボン含有量0.02重量%)に、平均粒径0. 5 μmのY₂ O₂ を 2. 5 重量%を添加し、ポリビニル プチラール (PVB) を適量加えAINスラリーとし た。このスラリーより、ドクタープレード法にて厚さ約 1 mmのグリーンシートを成形し、さらに65×65m m角に打ち抜き加工した。

【0015】外形加工の後、図1に示すように、グリー ンシートのピアホール10、13の位置にスルーホール を形成し、さらに切欠15を打ち抜いた。引き続き、W 粉末 (平均粒径1. 3 µm)、WOa 粉末 (10 µm) を重量比で3:1となるように配合したのちシートと同 40 じAlN粉末を体積比で1:1となるように加え、エタ ノールを溶媒として用い、アルミナポールによる湿式の ミリングを12時間行った。引き続き有機結合剤として PMMA (ポリメチル・メタ・アクリレート) と、酢酸 プチルを適量加え12時間のミリングを行った後、テレ ピネオールを資量加えて粘度を調整し、三本ロールミル を置し、印刷用ペーストとした。

【0018】このペーストをAINグリーンシート上に スクリーンマスクを用い厚さ約15μmのヒータパター ン (図1に示す発熱低抗体6、9) を形成した。またス 50 6, 9

ルーホール10、13にも同様にペーストを充填した。 乾燥後、荷瓜400kg/cm²、温度130℃で図2 に示すように、積層した。ついで、1.6 tのCIP (冷間等方プレス) をかけた。

【0017】積層体を混測水素 (N2 -8%H2) 雰囲 気で、600℃、8時間の脱脂を行った。引き続き、窒 業雰囲気中で1840℃、6時間の焼成を行い図3に示 す焼給体20を得た。ピアホール13の露出部にNI-Bメッキを施して電極とし二クロム線16をろう付けし ・積層方向の導通はピアホールを用いることによ 10 た。焼結体20は、基板1~4の積層体である。同種の **積層体をアルミナを基板として製造し、比較例とした。** 【0018】 家旅例及び比較例について預量試験(約5

秒で800℃となるように100℃を印加)を行い、プ レート状基体の温度分布をサーモビューアにより観察し た。100 V印加1砂後の温度分布及び5秒後の定常状 施における観察結果を図4~図7に示した。図4は実施 例の上面、図5は実施例の下面を示し、それぞれ100 V印加1秒後(a)に示すように、200℃のリング状 の領域21と、250℃のコア領域22が観察され、5 発熱抵抗体9を有する。第3層基板3はセラミック基板 20 秒後には(b)に示すように800℃の一様な加熱敏2 3が観察された。図6は比較例の上面、図7比較例の下 面を示し、それぞれ100V印加1秒後(a)に示すよ うに、150℃の領域24と島状の領域25とを生じ、 5 秒後に(b) に示すように800℃の定常状態におい ても700℃の周縁領域26、750℃の中央領域2 7、800℃の電極近傍領域28を生じ、一様な加熱状 態とならなかった。

[0019]

【発明の効果】以上に述べたように本発明によると、基 30 体にA1Nを用い、プレート内の温度分布の均一性が著 しく向上したセラミックヒータを実現することができ る.

【図面の簡単な説明】

【図1】実施例の4枚の基板の平面図である。

【図2】 実施例のセラミックヒータの積層構造を示す斜 棋図である。

【図3】 実施例のセラミックスヒータの (a) 平面図、 (b) 側面図である。

【図4】サーモビュアによる実施例の観察面の説明図で ある.

【図5】サーモピュアによる実施例の観察面の説明図で ある。

【図6】サーモビュアによる比較例の概察面の説明図で ある。

【図7】サーモピュアによる比較何の観察面の説明図で ある.

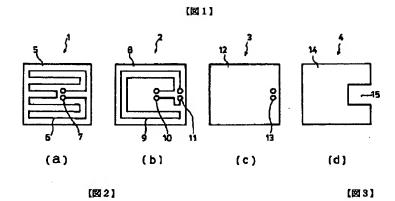
【符号の説明】

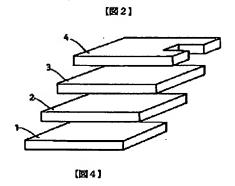
- 1, 2, 3, 4 基板
- 5, 8, 12, 14 セラミック基板
- **発熱抵抗体**

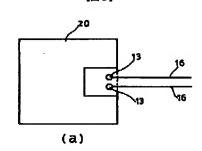


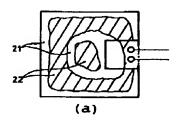
7, 11 増子 10, 13 ピアホール 15 切欠

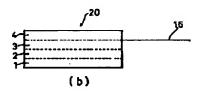
16 二クロム線 20 焼結体

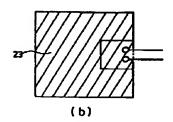


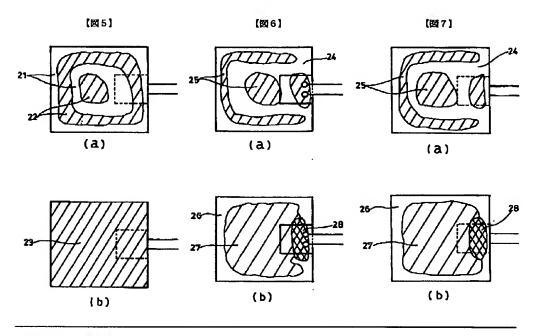












フロントページの続き

(72)発明者 前田 集造 千葉市川崎町 1 番地 川崎製鉄株式会社技 物研究本部内 (72)発明者 離谷 正人 千葉市川崎町1番地 川崎製鉄株式会社技 裕研完本部内